4.2 pn结二极管pn junction diode

常见的pn结二极管:

- 变容二极管
- 开关二极管
- 雪崩二极管
- 隧道二极管

二极管结电容特性:

- 扩散电容(正偏: 损耗电导)
- 势垒电容(常用反偏、零偏: 变容二极管)

4.2.1 变容二极管varactor diode

理想阶跃结二极管单位面积势垒电容量:

$$C_{\rm B} = \varepsilon_{\rm r} \varepsilon_{\rm 0} / X_{\rm D} \propto (V_{\rm D} + V_{\rm R})^{-1/2}$$

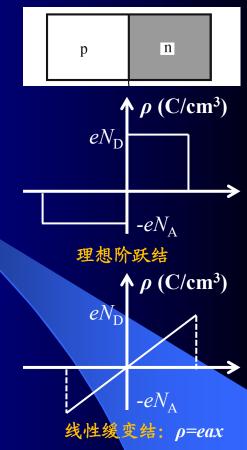
线性缓变结二极管单位面积势垒电容量:

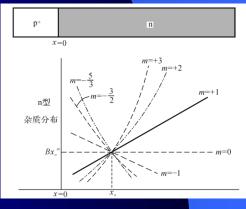
$$C_B \propto (V_{\mathrm{D}} + V_{\mathrm{R}})^{-1/3}$$

更一般的情况: $N = Bx^m$

- m=0,为均匀掺杂结;
- m = +1, 为线性缓变结;
- m = +2、+3, 重掺杂n+ 基片上外延低杂质浓度n层;
- m是负值,为超突变结。

$$C_{\rm B} \propto (V_{\rm D} + V_{\rm R})^{-1/(m+2)}$$





一般情况: $N = Bx^m$

- 反偏电压V=-V_R
- 变容二极管: $C_{\rm B} \propto (V_{\rm D} + V_{\rm R})^{-1/(m+2)}$
- 变容二极管的电抗以可控方式随偏压变化,如果 变容二极管并联电感,则LC回路的谐振频率为:

$$f_{\rm r} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{\rm B}}} \propto (V_{\rm D} + V_{\rm R})^{\frac{1}{2(m+2)}}$$

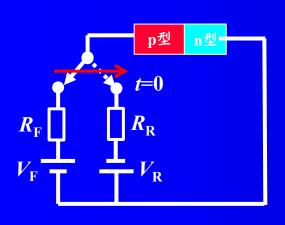
$$m = -\frac{3}{2} \Longrightarrow f_{\rm r} \propto (V_{\rm D} + V_{\rm R})$$

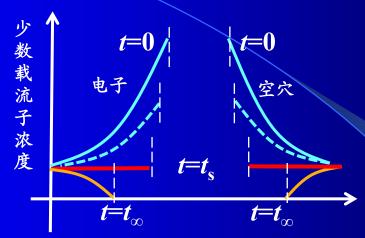
超突变结的谐振频率与反偏电压成正比

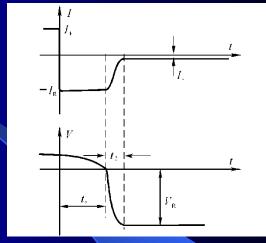
- 常用Si晶体作为变容二极管材料
- 外延生长或离子注入制作超突变结

4.2.2 开关二极管

pn结电子开关: pn结导通(on)、不导通(off)



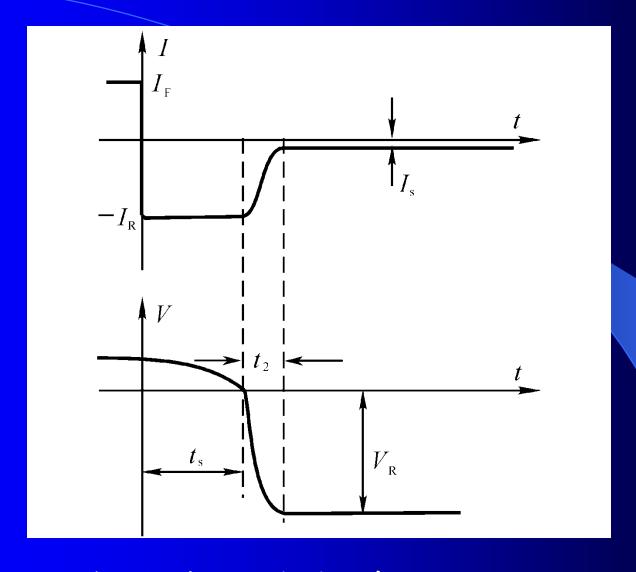




• t < 0, 落在结上正偏压为 $V_{\rm D}$, 结两侧扩散区内少子积累,正偏电流为:

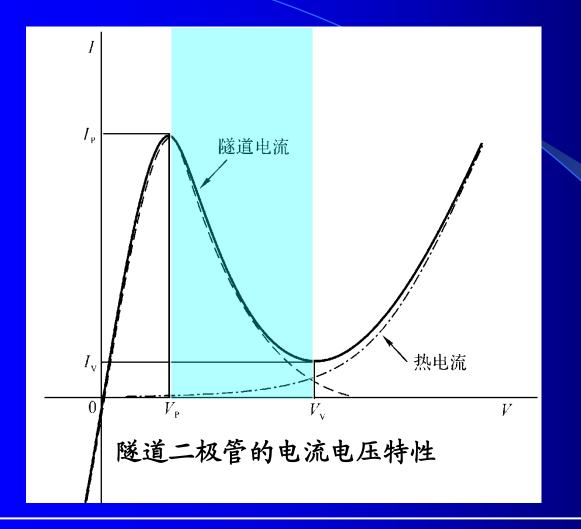
$$I_{\scriptscriptstyle \mathrm{F}} = (V_{\scriptscriptstyle \mathrm{F}} - V_{\scriptscriptstyle \mathrm{D}}) / R_{\scriptscriptstyle \mathrm{F}}$$

- t=0, 结上压降保持 $V_{\rm D}$ 不变, 反向电流为: $I_{\rm R}=(V_{\rm R}+V_{\rm D})/R_{\rm R}\approx V_{\rm R}/R_{\rm R}$
- $0 < t < t_s$, 反向电流近似恒定: $I_R \approx V_R / R_R$, 扩散区内存储的少子流出被消耗, 结上正偏压逐渐下降到0, t_s 本为存储时间。
- $t > t_s$, pn结开始反偏,p区和n区内部的少子被反向抽取,空间电荷区增大。
- $t>t_{\rm s}+t_{\rm 2}$, pn结稳定, $V_{\rm R}$ 电压全落在pn结上,电流为反向饱和电流。



开关二极管的反向总恢复时间: $t_r = t_S + t_2$

4.2.3 隧道二极管tunnel diode



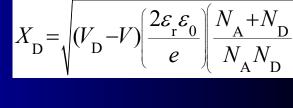


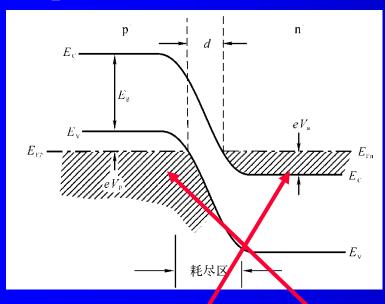
Scanned at the American Institute of Physics

- · 1958年由江崎在研究重掺杂锗PN结时首次发现,1973年获得诺贝尔奖。
- 隧道是量子效应,不受电子渡越时间限制,因此隧道二极管可在极高的频率 工作(100GHz),广泛应用于微波放大,高速开关等。

4.2.3 隧道二极管tunnel diode

p+n+(重掺杂)二极管





- 重掺杂:使得n区和p区的费米能级分别进入导带和价带,从而n区导带和p 区价带出现具有相同能量的量子态。
- 重掺杂:使耗尽区宽度变得很窄,隧 道距离很小(约5~10 nm),提高了 隧穿几率。T∝exp(-2d)

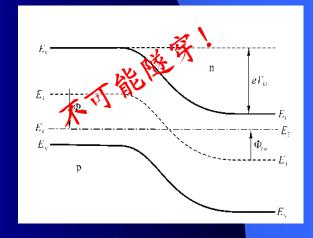
热平衡

$$n=N_{\mathbf{D}}>N_{\mathbf{C}}$$

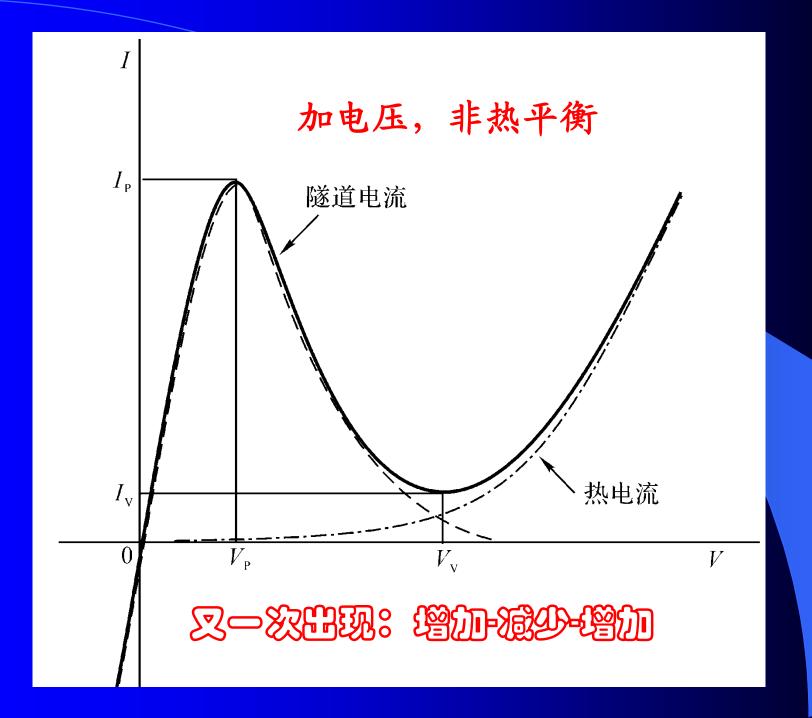
$$p=N_{\mathbf{A}}>N_{\mathbf{V}}$$

$$E_{\mathbf{F}}(T)=E_{\mathbf{C}0}+k_{\mathbf{B}}T\ln\left(\frac{N_{\mathbf{D}}}{N_{\mathbf{C}}}\right)$$

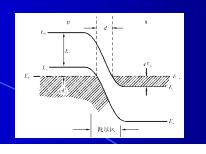
$$E_{\mathbf{F}}(T)=E_{\mathbf{V}0}-k_{\mathbf{B}}T\ln\left(\frac{N_{\mathbf{A}}}{N_{\mathbf{V}}}\right)$$



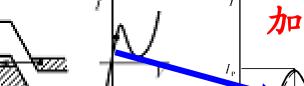
常规二极管



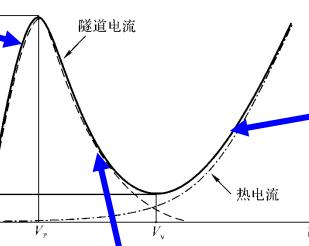
隧道效应: n区导带 电子进入p区价带, 产生正向隧道电流



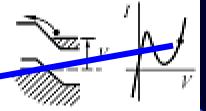
2



加电压, 非热平衡



只有热电流, 没有隧道效 应产生的隧 道电流



4

隧道效应: p区价带电子进入n区导带,产生 反向隧道电流 隧道效应: n区导带电子进入p区价带,产生正向隧道电流,但p区价带顶介于n区导带底和EF之间

4.2.4 雪崩二极管

雪崩二极管

pn结雪崩效应 载流子渡越效应

微波频率下的负阻效应(用作微波振荡源)

- •崩越二极管
- •俘获二极管

崩越二极管: n+pip+型里德(Read)二极管



i代表高阻层,p型材料高阻层为π层,n型材料高阻层为ν层

高反偏电压

n+p结雪崩击穿(雪崩区)

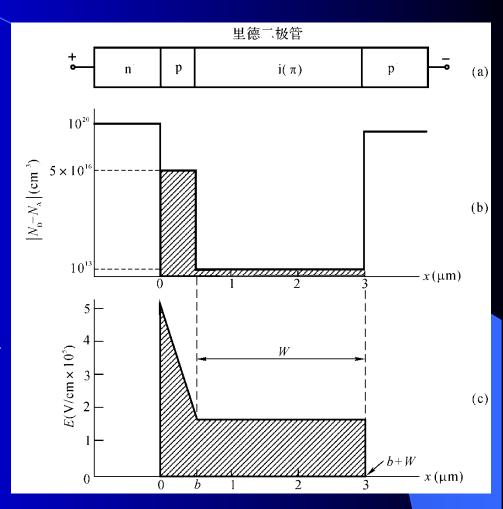
雪崩载流子, 形成雪崩区电流

次强电场 (漂移区)

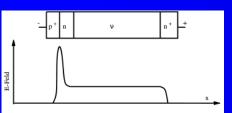
p区很薄,漂移区主要是i区

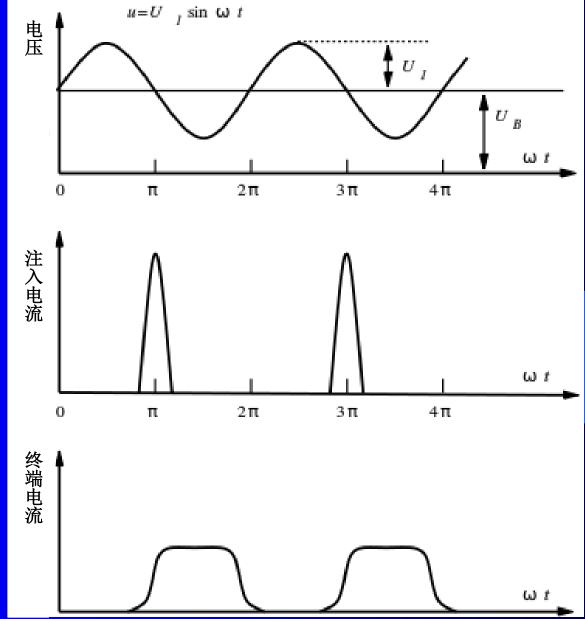
空穴以的饱和速度漂移运动,

由p+区收集,形成外电流



$$\frac{\mathrm{d}^2 \Phi(x)}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{\mathrm{d}E(x)}{\mathrm{d}x} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_{\mathrm{r}} \varepsilon_{\mathrm{0}}}$$





电流与电压之间有π的相位差,负阻效应

4.3 双极型晶体管

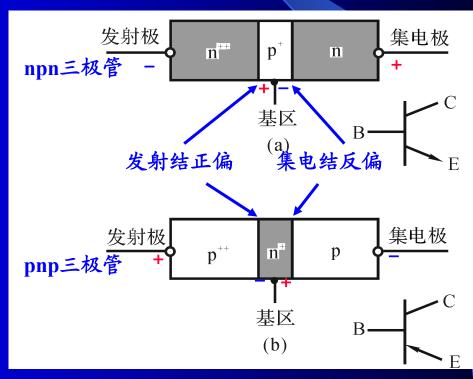
4.3.1 晶体管的基本结构和工作原理

三个独立的掺杂区和 两个pn结(互相影响、背靠背)

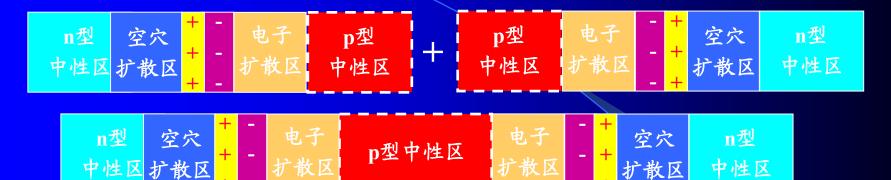
晶体管:

- 有源三端器件
- 电子、空穴两种载流子电流
- 双极型器件

基本工作原理在"电路 分析原理"和"电子电 路基础"中有介绍



npn三极管 ≠ np二极管 + pn二极管



npn三极管 = np二极管 + pn二极管+互相影响



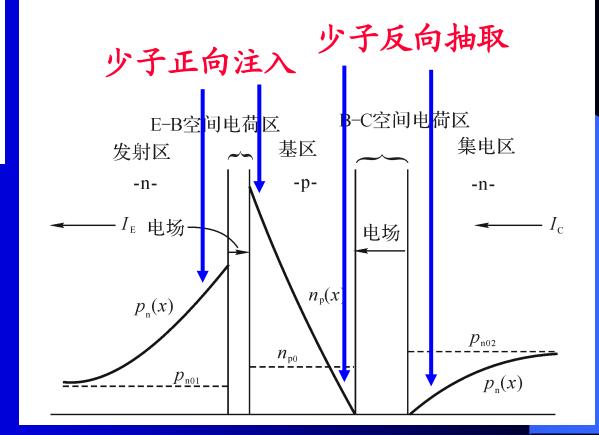
n型 空穴 + - _{电子} - + 空穴 n型 中性区 扩散区 + - + 扩散区 中性区

两个背靠背pn结互相影响:基区宽度比少子扩散区短

n^{++} p^{+} (a) (b)

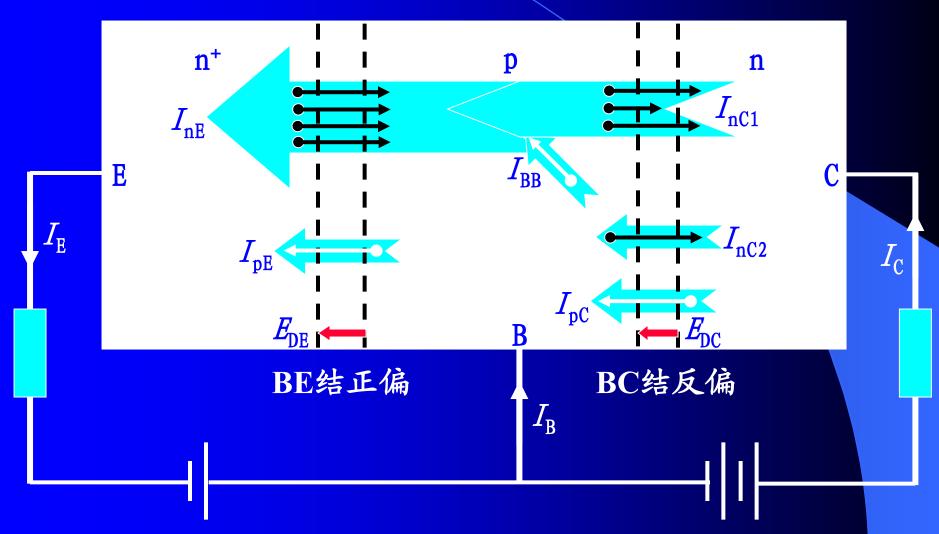
两个互相影响pn结

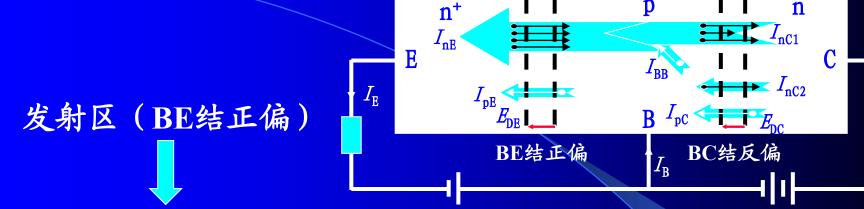
基区宽度比少子扩散长度短晶体管每个区域内少子浓度分布:



4.3.2 晶体管的放大作用

共基极npn晶体管:



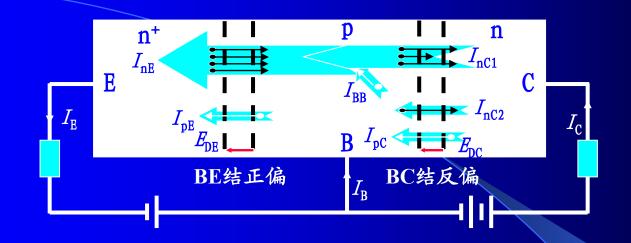


内建电场下降、势垒下降

发射区的电子(多子) 加速穿过BE结注入基区, 基区的(少子)电子浓度增加, 形成电子扩散电流I_{nE}

基区的空穴(多子)加速穿过BE结注入发射区发射区的(少子)空穴扩散电流I_{DE}

发射极电流 $I_{\rm E} = I_{\rm nE} + I_{\rm pE}$



基区:

电子扩散电流InE

基区较薄

大部分扩散到BC结

BC结反偏很高

电子迅速漂移扫入集电区,

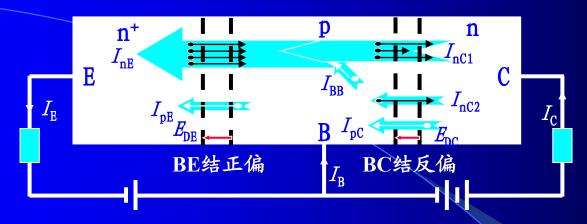
形成电子扩散电流I_{nC1}

少部分与基区的

空穴 (多子) 复合

人上法

复合电流IBB



基区的电子(少子)

热运动

BC结p区边缘

集电区的空穴(少子)

热运动

BC结n区边缘

BC结反偏、内建电场增加

电子迅速漂移

进入集电区,

形成电子电流InC2

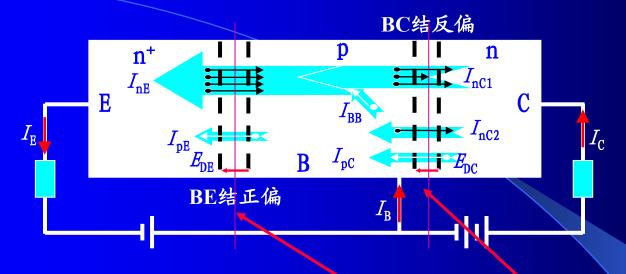
空穴迅速漂移

进入基区,

形成空穴电流IpC

BC结反向饱和电流

$$I_{\mathrm{CB0}} = I_{\mathrm{nC2}} + I_{\mathrm{pC}}$$



发射极电流

$$I_{\rm E} = I_{
m nE} + I_{
m pE}$$

集电极电流

$$I_{\rm C} = I_{\rm nC1} + I_{\rm nC2} + I_{\rm pC} = I_{\rm nC1} + I_{\rm CB0}$$

BC结反向饱和电流

$$I_{\rm CB0} = I_{\rm nC2} + I_{\rm pC}$$

电子电流

$$I_{\mathrm{nE}}$$
, I_{nC1} , I_{nC2}

空穴电流
$$I_{\rm pE}$$
、 $I_{\rm BB}$ 、 $I_{\rm pC}$

双极型

集电极电流受正偏BE电压控制,与反偏BC电压无关。器件中某部分电流收到另-分电压的控制。由"低电阻输入"到"高电阻输出(trans+resistor=transistor)

- 4.3.3 电流—电压特性
- 4.3.4 击穿电压与穿通电压
- 4.3.5 频率特性
- 4.3.6 开关特性

这四小节的内容在

"电路分析原理"和"电子电路基础"中有介绍

4.3.7 晶体管噪声

晶体管放大器的主要噪声:

- 外界: 输入、感应、耦合等方式引进的噪声
- 晶体管本身:
 - 热噪声: 载流子无规则热运动引起电流起伏(温度愈高,热噪声也愈大)
 - 散粒噪声: 载流子数目将在平均值附近起伏
 - 低频1/f噪声(1/f):表面能级、晶格缺陷、位错和晶体不均匀性

噪声系数: F = 输入信噪比 / 输出信噪比

4.4 金属—半导体接触和肖特基势垒

金属—半导体(简称金—半或M-S)接触:整流器、检测器、二 极管、场效应晶体管、太阳能电池、半导体集成器件电极

4.4.1 理想肖特基势垒Schottky barrier

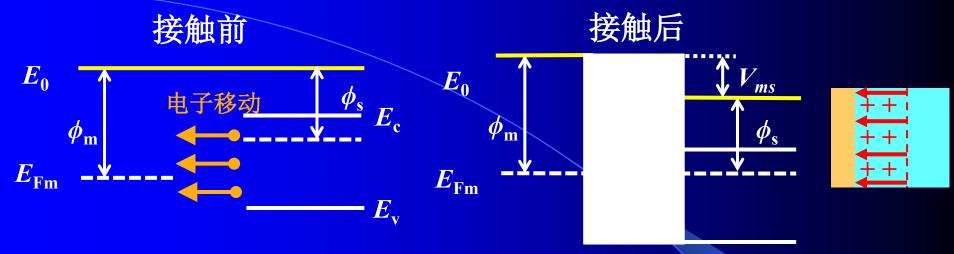
•真空能级E₀:表面外真空中电子势能,固体中刚能够脱离固体, 发射到真空中的电子能量(真空能级连续)

•金属功函数 ρ_m : 电子从金属中逸出到表 面外的真空中去至少需要的能量。金属费米 能级以上为空态、以下充满电子。

$$\phi_{\rm m} = E_0 - E_{\rm Fm}$$

·半导体功函数φ: 半导体费米能级与真空能级之差。 $\phi_{\rm s} = E_0 - E_{\rm Fs}$

•电子亲和势火: 真空能级与半导体导带底之差 (不变) $\chi = E_0 - E_C$



$$\phi_{\rm m} > \phi_{\rm s}$$
 $E_{\rm Fs} > E_{\rm Fm}$ 电子从半导体流向全层

电子从半导体流向金属

接触电势差大小为:

$$V_{\rm ms} = (\phi_{\rm m} - \phi_{\rm s})/e$$

金属表面负电荷、半导体表面带等量正电

产生接触电势差(降低/提高了半导体/金属的电子势能)

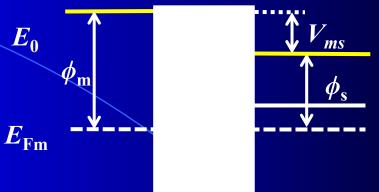
接触电势差阻止半导体中电子继续流向金属

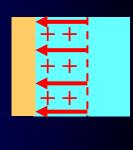
平衡状态时 统一的费米能级 没有电子的净流动



接触电势差大小为:

$$V_{\rm ms} = (\phi_{\rm m} - \phi_{\rm s})/e$$





金属表面负电荷、半导体表面带等量正电

负电荷集中在表面金属

半导体一侧留下固定的电离施主

金属内部电场为零 (压降为零)

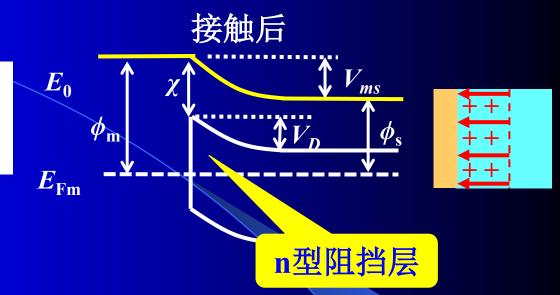
半导体表面形成一定厚度的空间电荷区

接触电势差落在半导体一侧的空间电荷区

空间电荷区半导体能带向上弯曲

接触电势差大小为:

$$V_{\rm ms} = \phi_{\rm m} - \phi_{\rm s}$$



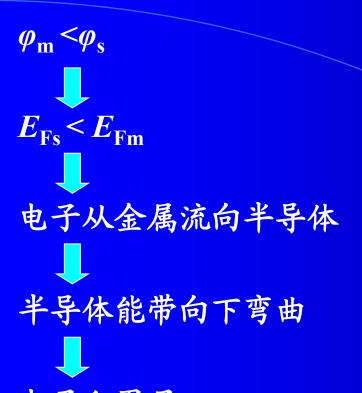
•半导体一侧的势垒高度(电子从半导体进入金属遇到的势垒)

$$V_{\rm D} = V_{\rm ms} = (\phi_{\rm m} - \phi_{\rm s})/e$$

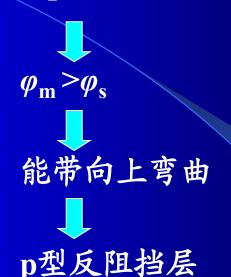
•金属一侧的势垒(电子从金属进入半导体遇到的势垒)

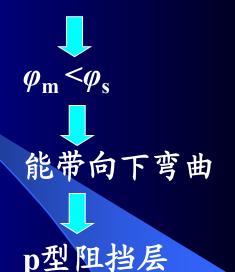
$$V_{\rm Dm} = (\phi_{\rm m} - \chi)/e$$
 肖特基势垒

•空间电荷区内,电子浓度比内部小得多,形成高阻的区域, 称为阻挡层。



p型半导体与金属接触





电子积累层

高电导层 n型反阻挡层 有利于n型中 的电子流向 金属

 E_0 $\phi_{
m m}$ $\phi_{
m s}$ $E_{
m Fm}$ 电子移动

接触前

